

# 酸エッチングおよび洗浄プロセス用 Ptfе シリコンウェハホルダー 2 4 6 8 インチ

## カスタマイズ可能 耐高温

商品番号: PL-CP158



### 前書き

過酷な酸エッチングおよび洗浄プロセス向けに設計された高純度PTFE製シリコンウェハホルダー。2インチから8インチのウェハに最適化された、頑丈でカスタマイズ可能なこのキャリアは、B2B調達における最も要求の厳しい半導体製造環境において、汚染のない取り扱いと熱安定性を保証します。

### 詳細を学ぶ

| 用途          | 説明                                                  | 主な利点                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 半導体エッチング    | 誘電体層を除去するために、濃縮HFまたはBOE（バッファードオキシドエッチ）溶液中でウェハを取り扱う。 | 侵襲性の高い酸に対する優れた耐性により、キャリアの長期的な耐久性が保証される。  |
| RCA洗浄プロセス   | 高温でのSC-1およびSC-2溶液を使用して、有機および金属汚染物質を除去する。            | 高い熱安定性により、高温酸化浴中の変形が防止される。               |
| 太陽電池セル生産    | 高効率太陽電池の製造中におけるシリコンウェハのテクスチャリングおよび洗浄。               | 堅牢な設計により、一貫した信頼性で大量産業スループットを処理する。        |
| MEMS製造      | 複雑な深反応性イオンエッチングおよびウェットリリースプロセス中に基板を確実に保持する。         | 精密加工されたスロットが、繊細な微小機械構造を接触損傷から保護する。       |
| ピラニアエッチ洗浄   | 硫酸と過酸化水素の混合物中でウェハを処理し、重有機物を除去する。                    | 材料は強力な酸化攻撃に対して影響を受けず、装置の劣化を防止する。         |
| ナノテクノロジー研究  | 実験的な化学気相成長または液相処理におけるカスタム基板の専門的な取り扱い。               | 完全なカスタマイズにより、非標準のウェハサイズと独自の形状サポートが可能。    |
| 光エレクトロニクス組立 | エピタキシャル成長または薄膜堆積前のサファイアまたはGaAsウェハの洗浄。               | PTFE材料の純度により、光学デバイスにおける微量金属干渉のリスクが排除される。 |

| 仕様カテゴリ   | PL-CP158のパラメータ詳細       | 可用性/オプション              |
|----------|------------------------|------------------------|
| モデルシリーズ  | PL-CP158 シリコンウェハキャリア   | 標準およびカスタム設計            |
| 主要材料     | 高純度PTFE（ポリテトラフルオロエチレン） | PFAオプションはリクエストに応じて利用可能 |
| 対応ウェハサイズ | 2インチ、4インチ、6インチ、8インチ    | 任意の直径に完全にカスタマイズ可能      |
| スロット構成   | 容量とピッチはプロジェクトごとに定義     | ユーザー仕様に合わせてカスタマイズ      |
| 温度範囲     | 極低温から260°Cまでの動作        | プロセス依存のカスタマイズ          |
| 耐薬品性     | 酸、塩基、溶剤の全範囲            | 普遍的化学互換性               |
| 製造方法     | 5軸CNC精密加工              | 特注形状利用可能               |
| 排水機能     | カスタマイズ可能な底面/側面排水口      | 特定のバス流量に最適化            |

|        |                          |                  |
|--------|--------------------------|------------------|
| 仕様カテゴリ | PL-CP158のパラメータ詳細         | 可用性/オプション        |
| ハンドル設計 | 取り外し可能または一体型の手動/ロボットハンドル | ツール互換性のためにカスタマイズ |
| 純度グレード | 微量分析および半導体グレード           | 認定高純度材料          |